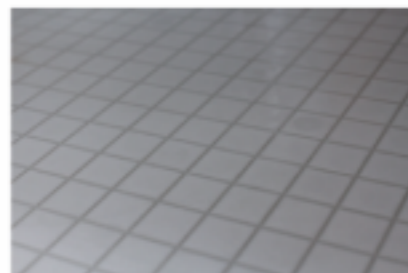


選配配件



冷卻盤



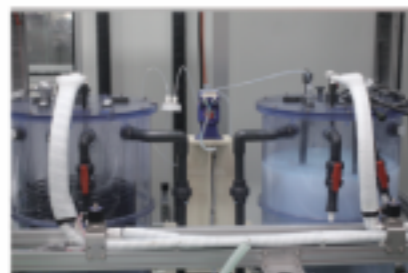
拋光墊



研磨盤



簡易供漿系統



自動供漿系統



研磨拋光墊修整環



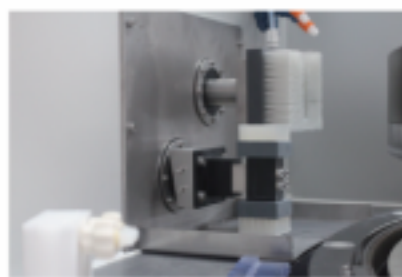
研磨拋光墊移除T型管



工件載具(客製化)



研磨拋光墊滾輪



自動清洗盤面



自動厚度偵測



自動工件取放機
(可搭配其他廠牌機型)



準力機械股份有限公司

428, 台中市大雅區昌平路四段282北六巷42號

tel : +886-4-2534-9475

fax : +886-4-2533-9001

e-mail : grinder@joenlih.com.tw

www.joenlih.com



CE SEMI S2

JL-2024-03-500EC



雙面拋光機 / 雙面研磨機

Double Side Polishing / Double Side Lapping Machine



機器特性

雙面拋光/研磨機適用於工件需要雙面同時加工，且又特別適於易翹曲之材料加工，機器可同時精密加工多片工件。

拋光/研磨後之工件具有優異的平面度、平行度與低翹曲特性。

機構採取行星式運轉設計，表面達到無機械紋路之效果(鏡面或霧面)。

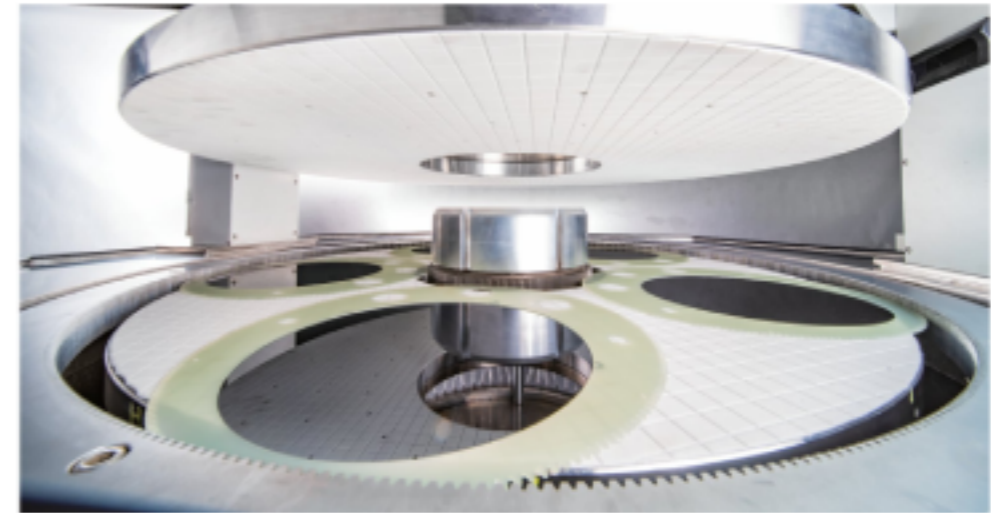
PLC控制器可搭配類人機介面(選配)，提供使用者簡單的操作方式。

準力提供客製化程式撰寫與維護。

適合研磨工件種類

非金屬: 矽晶圓、碳化矽晶圓、石英玻璃、藍寶石、氮化鋁、砷化鎵、鑽石晶圓

金屬: 氧化鋁、銅、不銹鋼、碳化鋼、十字鋼等



選配 (圖示詳見下一頁)

- 冷卻盤：強化加工時工件平面度。
- 拋光墊：針對客戶拋光需求搭配不同材質拋光墊。
- 研磨盤：針對不同材質客製化研磨盤。
ex: 等低熱膨脹係數不銹鋼、INVAR研磨盤。
- 簡易供漿系統：粗細拋光/研磨液手動切換。
- 自動供漿系統：粗細拋光/研磨液自動切換。
- 研磨拋光墊修整環：研磨拋光墊修整使用。
- T型管：研磨拋光墊去除使用。
- 拋光研磨載具：根據材質與工件形狀大小客製化載具。
- 研磨拋光墊滾輪：研磨拋光墊黏貼使用。
- 自動清洗盤面：盤面自動清洗與保濕。
- 自動厚度偵測：根據工件厚度與材質設計安裝厚度偵測儀。
- 自動工件取放：客製化工件取片與放片。